



journal6 » 2004, Vol. 24 » Issue (4): 22-26

[论文](#)

[本期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[« 前一篇](#) | [后一篇 »](#)

CVD过程中温度对SiC涂层沉积速率及组织结构的影响

刘荣军, 张长瑞, 刘晓阳, 周新贵, 曹英斌

国防科技大学, 航天与材料工程学院, 国防科技重点实验室, 湖南, 长沙, 410073

The effects of deposition temperature on the depositon rates and structures of CVD SiC coatings

LI U Rongjun, ZHANG Changrui, LI U Xiaoyang, ZHOU Xingui, CAO Yingbin

Key Laboratory of National Defense Technology, College of Aerospace & Materials Engineering, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献](#)

[相关文章 \(15\)](#)

中国航空学会 主办

中航工业北京航空材料研究院 承办

版权所有 © 《航空材料学报》编辑部 总访问量:

地址: 北京81信箱62分箱 邮政编码: 100095

电话: 010-62496277 传真: 010-62456212 E-mail: hkclxb@biam.ac.cn

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn